

半導体プロセス装置などのウエハの振動・レベリング・温度・湿度を測定、データ化し、装置調整やメンテナンスを効果的に行えるようにするウエハライクの測定器です。



半導体プロセス改善用 ウエハ型マルチセンサー VSS II

- ▷生産性向上
- ▷プロセス中のウエハの破損防止
- ▷装置メンテナンス時間削減

仕様

機能	振動 レベリング 湿度 温度 (1)	サイズ	300mm/200mm 厚さ：4mm(±0.2mm)	
サンプルレート (S/s)	125,250,500,1000	重さ	242g	
測定範囲	加速度 (g)	±2, ±4, ±8	処理機能	YT, スペクトル, 角度分析, ベクトル和, 振動変位, イベント検知
	ピッチ (°)	±45°	モード	継続的に測定
	ロール (°)	±45°	データ保存	コンピューター (Bluetoothを使用)
解像度	加速度 (20-bit)	4 µg @ 2g range 8 µg @ 4g range 16 µg @ 8g range	フィルター機能	ローパス, ハイパス バンドパス, バンドストップ
	ピッチ (°)	0.005°	スペクトル分析	FFT, パワースペクトル パワースペクトル密度
	ロール (°)	0.005°		
温度	0°C~60°C (±0.3°C)	統計	最大値(Max), 最小値(Min), 実効値(RMS), 平均値(Mean), ピーク値(P-P)	
湿度	0%~100% RH (±2% @20%~80%)	FFT平均	実効値, ピークホールド, None	
インターフェース	Bluetooth	データ再生	早送り, 巻き戻し, 再生	
電源	バッテリー内蔵	データ出力	CSV/Excel	
稼働時間	4時間以内	言語	英語	
(1) : 温度と湿度のサンプリングレート : 1 S/s				

特徴

ウエハ形状

ウエハと一緒に搬送可能

オフライン測定

ログファイル保存

マルチセンサー内蔵

振動・レベリング
温度・湿度

ワイヤレス測定

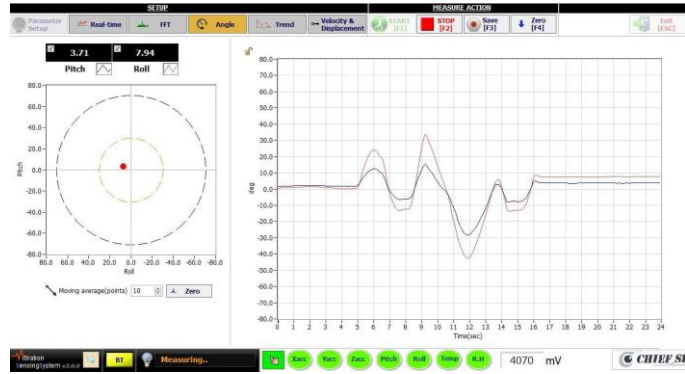
4時間継続測定

ソフトウェア
スペクトル分析、
角度分析、トレンド分析

ソフトウェア



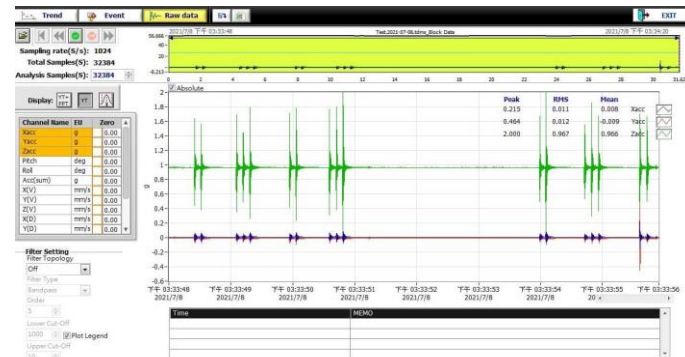
リアルタイム波形



角度分析



FFT



生データレポート

